BEAM FOCUSING AND DEFOCUSING USING CHANNELING PHENOMENA

Y. Takabayashi ^{#,A)}, A. V. Shchagin^{B)} ^{A)} SAGA Light Source 8-7 Yayoigaoka, Tosu, Saga 841-0005, Japan ^{B)} Kharkov Institute of Physics and Technology Kharkov 61108, Ukraine

Abstract

If a charged particle is incident on a single crystal along its axis or plane, the motion of the charged particle is guided by the potential of atomic row or plane in the crystal. This phenomenon is called "channeling". In this study, we propose a new method for beam focusing and defocusing using channeling phenomena in a bent crystal. As the first step, we have observed axial and planar channeling of 255-MeV electrons in a flat silicon crystal.

チャネリング現象を利用したビーム制御技術の提案

1. はじめに

荷電粒子が単結晶の軸や面に沿ってほぼ平行に入 射すると、荷電粒子は原子列や原子面のつくるポテ ンシャルによってガイドされながら結晶中を進む (チャネリング現象)。原子列や原子面のつくる電 場は強力で、磁場に換算すると数 100 テスラにも 匹敵することが知られている。この特性に着目し、 湾曲した結晶(Bent crystal)を用いて、CERN-SPS^[1]、 Tevatron^[2]、RHIC^[3]等において、高エネルギーのイ オンビームを偏向させる研究が行われてきた。日本 でも、KEK-PS で陽子ビームを偏向させる実験が行 われている^[4]。また、広島大学の電子周回装置 (REFER)では、電子ビームを用いて偏向実験が行 われた^[5]。

このように、ビームの偏向を目的とした研究が多 く行われてきたが、本研究では、チャネリング現象 を利用してビームをフォーカス・デフォーカスする ことを提案する。はじめに、実験装置、チャネリン グの実験結果について述べる。次に、チャネリング 現象を利用したビームのフォーカス・デフォーカス 技術について議論する。

2. 実験装置

2009 年度から、相対論的電子ビームと結晶の相 互作用研究を目的としたビームラインの設計を開始 し、2010 年 3 月に九州シンクロトロン光研究セン ター(SAGA Light Source: SAGA-LS)のリニアック 室への設置が完了した⁶⁰。図 1 にビームラインの概 念図を示す。結晶の角度を制御するゴニオメーター、 結晶透過後のビームプロファイルを観測するための スクリーンモニタ、ベリリウム窓を備えた X 線取 り出しポートなどから構成されている。

図2に結晶の角度を制御するゴニオメーターの概 念図を、表1にその性能を示す。θは水平面内、φは 鉛直面内における角度に対応する。





表1:ゴニオメーターの性能。		
	駆動範囲	最小ステップ
θ軸	$-180^\circ \sim +180^\circ$	0.000069°
φ軸	$-10^{\circ} \sim +10^{\circ}$	0.000019°
X 軸	$-50 \sim +50 \text{ mm}$	0.002 mm



[#] takabayashi@saga-ls.jp

スクリーンモニタは、厚さ 100 μ m のアルミナ蛍 光板(デマルケスト)と CCD カメラ(白黒、Gigabit Ethernet 仕様)から構成されている。CCD カメ ラで取得した画像は、専用の LAN ケーブルと画像 取得ボードを経由してパソコンで取得される。そし て、水平(x)・垂直(y)方向のビームプロファイルは、 オンラインでガウス関数によりフィットされ、ビー ムのピーク位置とビームサイズ σ が求められるよう になっている。

X 線取り出しポートのベリリウム窓の直径は 30 mm、厚さは 250 μm である。本報告では詳しく述べないが、チャネリング電子からのパラメトリック X 線に関する研究も行っている。

3. チャネリングの観測

3.1 ビームパラメータ

Q スキャン法(4 極電磁石の磁場の強さを変えて いきビームサイズを測定する方法)を用いて、ビー ムの規格化エミッタンスとツイスパラメータの評価 を行った^[6]。表 2 に結果を示す。また、これらの値 を用いて、結晶位置におけるビームサイズと角度拡 がりを計算した結果を図 3 に示す。計算は、結晶の 上流に設置されている 4 極電磁石の K 値の関数とし て行った。図 3(b)の水平の実線は、255 MeV 電子が シリコン結晶の<100>軸をチャネリングする場合の 臨界角(0.044° = 0.76 mrad)と(220)面をチャネリン グする場合の臨界角(0.025° = 0.43 mrad)を示す。 広い範囲にわたってビームの角度拡がりは臨界角よ りも十分小さいことが確認された。最終的に、矢印 で示した設定値で、チャネリング実験を行った。

表	2	: (Qスキャン法により求めた規格化エミッタン
ス	と	4	極電磁石入口位置におけるツイスパラメータ。



図3:結晶位置における(a)ビームサイズと(b)ビー ムの角度拡がり。横軸は4極電磁石のK値。

3.2 軸チャネリング

SAGA-LS リニアックからの 255 MeV の電子ビー ムを厚さ 20 µm のシリコン結晶に入射させ、チャネ リング実験を行った。このシリコン結晶の<100>軸 は結晶表面に垂直であり、(220)面が水平となるよう に結晶を設置した。図1に示した上流側のスクリー ンモニタを用いて、結晶透過後のビームプロファイ ルを観測した。結晶とスクリーンモニタ間の距離は 1.82 m であった。

図 4 に結晶の角度0をスキャンしたときの、結晶 透過後のビームプロファイルを示す。x は水平、y



図4: <100>軸チャネリング条件近傍における結晶 透過後のビームプロファイル。

は垂直方向の位置である。θ=0°が<100>軸チャネリ ング条件に対応する。 $\theta = \pm 0.04^{\circ}$ 付近では、ビーム は<100>軸を傾けた方向(x方向)に偏向されてい た。 $\theta = \pm 0.08^{\circ}$ 付近では、軸チャネリングに特徴的 なドーナツ型のプロファイルが観測された。さらに θを大きくしていくと、もはや電子はチャネリング しなくなり、0°方向(もとの進行方向)に出射した。 図 5 に結晶の角度0対ビームのピーク位置・大き さを示す。これらの値は、水平・垂直方向のビーム プロファイルを、ガウス関数でフィットすることに より求めた。水平・垂直方向のプロファイルは、条 件によっては複雑な形状を示したが、簡単のため、 全てガウス関数でフィットを行った。図5の右側の 縦軸には、ビームの偏向された角度(ビーム位置の 変化量を結晶とスクリーン間の距離 1.82 m で割っ た値)を示した。図5から、主に下記のことが見て とれる。(i) θが臨界角付近で、ビームの偏向角は最 大になった。その大きさは~0.8×101程度であった。 (ii) θをさらに大きくしていくと、ビームは偏向され なくなった。(iii) θ = 0°におけるビームサイズは、 ランダム入射条件(非チャネリング条件)時の値よ りも大きくなった。(iv) θが臨界角を超えたところ で、ビームサイズは最大になった。

なお、 ϕ 方向に関してもスキャンを行ったが、xとyが入れ替わる以外、図 4・図 5 と同様の結果が 得られた。

現在、ロシアのトムスク工科大学の理論グループ が、チャネリングのシミュレーションを行っている ^[7]。今後、実験とシミュレーションの比較を行う予 定である。



図 5:結晶の角度θ対(a)ビーム位置と(b)ビームサ イズ。

3.3 面チャネリング

次に、同じセットアップを用いて、面チャネリン グの観測も行った。前述したように、(220)面が水平 となるように結晶を設置したので、(220)面のチャネ リングを観測するため、角度 ϕ に関するスキャンを 行った。図 6 に結晶透過後のビームプロファイルを、 図 7 に結晶の角度 ϕ 対ビームの位置・大きさを示す。 なお、このときの θ の値は-19.2°であった。 $\phi = 0°$ が (220)面チャネリング条件に対応する。

図 6・図 7 からわかるように、面チャネリングの 場合も、わずかではあるが、ビームの偏向される様 子が観測された。また、 $\phi = 0$ °において、 y 方向 (チャネリングの振動方向に平行)のビームサイズ は最大となった。これは、チャネリング電子が原子 核・電子密度の高い原子面付近を通過するため、大 きく散乱されやすいことにより説明される。また、 $\phi = 0$ °から少しずれたところで、x 方向のビームサイ ズは減少した。y 方向と同様、x 方向のビームサイ ズも増大すると考えていたが、予想に反した結果が 得られた。原因について現在検討中である。



図 6:(220)面チャネリング条件近傍における結晶 透過後のビームプロファイル。



図7:結晶の角度¢対(a)ビーム位置と(b)ビームサ イズ。

4. フォーカス・デフォーカス技術の提案

前節で議論したように、チャネリング現象を利用 してビームを偏向させることが可能である。特に、 軸チャネリングの場合の方が、その効果が大きいこ とが示された。この結果を踏まえ、湾曲した結晶を 用いた、ビームのフォーカス・デフォーカス技術を 提案する。図8に、その概念図を示す。図に示した ように、結晶を湾曲させると、結晶の軸の方向が入 射位置によって変化する。ビームは軸方向に偏向さ れると考えられるので、湾曲結晶に入射されたビー ムはフォーカス・デフォーカスされることが期待さ れる。

本研究では今後、電子ビームを用いて、フォーカ ス・デフォーカス技術の検証実験を行う予定である。



図 8:湾曲結晶によるビームのフォーカス・デ フォーカスの概念図。 しかし、電子を用いる場合、多重散乱の影響が大き いため、フォーカス・デフォーカスの効果がはっき りと現れない可能性がある。例えば、20 µm 厚シリ コン結晶における 255 MeV 電子の多重散乱角は 0.5 mrad であり、これは入射ビームの角度拡がり 0.2 mrad よりも大きい。本研究の範囲を超えるが、多 重散乱の影響の小さいイオンビームを用いた検証実 験も重要であると考えられる。

また、湾曲結晶の作成方法も課題の1つである。 現在、厚さ20µmのシリコン結晶を用いているが、 この程度の厚さであれば、ある程度湾曲させること が可能である。第1案として、カーブ形状を持った ホルダーを作成し、それに沿わせて結晶を固定する 方法を検討している。

本研究で提案した手法の特徴は、4 極電磁石と異 なり、電磁石電源が不要であることと、1 方向のみ のフォーカス・デフォーカスが行えることである。 問題点は、前述したように、多重散乱の影響が大き いことである。しかし、有用な応用例としてビーム の取り出し窓が考えられる。ビームを大気中に取り 出す場合、取り出し窓による多重散乱の影響は避け られないが、その窓として湾曲結晶を利用すれば、 ビームの拡がりを抑えられる可能性がある。

5. まとめ

SAGA-LS リニアックからの 255 MeV の電子ビー ムを厚さ 20 μm のシリコン結晶に入射し、<100>軸 チャネリングと(220)面チャネリングの観測を行った。 結晶を傾けることにより、ビームの偏向される様子 が観測された。この実験結果を踏まえ、湾曲結晶を 用いて、ビームをフォーカス・デフォーカスする方 法を提案した。今後、検証実験を行う予定である。

謝辞

チャネリングに関して理論面からの助言を下さった、ロシアトムスク工科大学のYu. L. Pivovarov 教授の理論グループに感謝いたします。

本研究を行う機会を与えて下さった、同センター 加速器グループの江田茂グループ長、岩崎能尊副主 任研究員、金安達夫副主任研究員、吉田勝英氏(前 加速器グループ長)、冨増多喜夫氏(前光源整備 チームリーダー)に感謝いたします。

本研究の一部は科研費(21740217)の助成を受け たものです。

参考文献

- [1] W. Scandale et al., Phys. Rev. ST 11, 063501 (2008).
- [2] R. A. Carrigan, Jr. et al., Phys. Rev. ST 5, 043501 (2002).
- [3] R. P. Fliller III et al., Phys. Rev. ST 9, 013501 (2006).
- [4] S. Strokov et al., J. Phys. Soc. Jpn. 76, 064007 (2007).
- [5] S. Strokov et al., Nucl. Instr. and Meth. B 252, 16 (2006).
- [6] Y. Takabayashi, T. Kaneyasu, Y. Iwasaki, Proceedings of the 7th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, 623 (2010).
- [7] T. A. Tukhfatullin, K. Korotchenko, Yu. L. Pivovarov, private communication.